

EVG supplies maskless lithography system to PMT - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability. “We can achieve significant cost savings, faster process development, and improved process performance, by switching from traditional lithography to EV Group’s LITHOSCALE maskless exposure product. We look forward to future collaborations with EVG leveraging LITHOSCALE and other process solutions for advanced probe card manufacturing.” stated Dr. Yong-Ho Cho, CEO of PMT.

HOME > 반도체

EVG, 피엠티에 마스크리스 리소그래피 시스템 공급

📅 노태민 기자 | 🕒 승인 2024.01.24 16:05 | 💬 댓글 0

100% 정품 부품을 이용하여 혁신적인 제품을 설계하세요
최소 SAE AS8496 품질인증
용접기업 사무서 일렉트로닉스



EVG가 피엠티에 마스크리스 리소그래피 시스템 공급 계약을 체결했다. 왼쪽부터 조용호 피엠티 대표이사, 운영식 EVG 한국지사장. <사진=EVG>

MOUSER ELECTRONICS 신제품 입고
자동차 및 산업용 표준 퓨즈
Littelfuse

오스트리아 장비 기업 EV그룹(EVG)이 프로텍엠스테크놀로지(피엠티)에 마스크리스 리소그래피 시스템을 공급한다고 24일 밝혔다.

EVG 리소스케일 장비는 마스크리스 익스포저(MLE) 기술을 적용해 마스크 없이 노광 공정이 가능하다. 피엠티는 해당 장비를 통해 메모리 웨이퍼 레벨 테스트용 프로브 카드를 양산한다는 계획이다. 피엠티는 MEMS 기반 프로브 카드를 제작하고 있다.

조용호 피엠티 대표는 “미세 피치 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패터닝 공정을 통해 제작되어 제조 비용 증가 최소화가 필요하다”며, “기존의 마스크 얼라이너(Mask Aligner)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG 마스크리스 노광 장비인 리소스케일로 대체함으로써, 제조 비용 및 공정 개발 속도 개선이 가능할 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

아날로그디바이스, 지속적인 배터리 모니터링을 가능하게 하는 BMS 솔루션 확장
ANALOG DEVICES
AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

운영식 EVG 한국지사장은 “피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁘다”고 밝히고 “리소스케일 장비는 높은 분해능, 다양한 많은 제품 설계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조에 이상적이다”라고 말했다.